

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 18 年 4 月 27 日 (2006.4.27)

【公表番号】特表 2006-503684 (P2006-503684A)  
 【公表日】平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)  
 【年通号数】公開・登録公報 2006-005  
 【出願番号】特願 2003-576100 (P2003-576100)  
 【国際特許分類】

**B 0 1 J 19/00 (2006.01)**

**C 0 1 B 3/16 (2006.01)**

【F I】

B 0 1 J 19/00 3 2 1

C 0 1 B 3/16

【手続補正書】  
 【提出日】平成 18 年 3 月 8 日 (2006.3.8)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】請求項 6 1  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【請求項 6 1】

入口端および出口端を有し、そして発熱反応触媒を含む反応マイクロチャンバー；

上記反応マイクロチャンバーと熱接触している少なくとも 1 つの熱交換マイクロチャンネル；および

上記反応マイクロチャンバーの入口端と熱接触しているヒーターを含む示差温度マイクロチャンネル化学加工処理装置であって：

発熱反応性反応体が上記反応マイクロチャンバーを通して流れ、かつ熱交換流体が上記の少なくとも 1 つの熱交換マイクロチャンネルを通して流れているとき、その反応マイクロチャンバーの出口端がその反応マイクロチャンバーの入口端よりも少なくとも約 2.5 冷たいことが可能である  
 上記の装置。